

P-736

用于微量滴定板的PI nano® Z向显微镜扫描仪

大通光孔径、低外形、带数字式控制器



- 快速步进和稳定
- 用于孔板的通孔尺寸、低外形易于集成
- 行程220 微米
- PICMA压电陶瓷促动器带来超长使用寿命
- 压阻式传感器实现更低成本
- 电容式传感器实现更高稳定性

用于高分辨率显微镜的精密等级纳米定位系统

优化后实现快速步进和稳定。18毫米的极低外形、易于集成。版本适用于从尼康到奥林巴斯的倒置显微镜。

PICMA压电陶瓷促动器驱动

全瓷绝缘实现最长操作时间。明显更高的防潮性。FEA模式化柔性铰链接头带来极佳导向精度。

反馈传感器的类型：压阻式或电容式

- 高分辨率、压阻式传感器确保稳定的位置控制
- 与压阻式传感器相比，直接测量型电容式传感器可实现明显更佳的稳定性和重复性

带控制器和软件的系统

紧凑型E-

709数字式伺服压电陶瓷控制器为随机配件。数字伺服可通过软件实现所有控制参数的即时自适应。通过USB、RS-

232和一个宽带模拟接口可实现控制。支持PIMikroMove, NanoCapture。PI总指令集（GCS）

用于LabVIEW的驱动器，用于Windows和Linux的共享库。可与µManager、MetaMorph、MATLAB兼容和Andor iQ。

应用领域

共焦显微镜、3D成像、激光技术、干涉测量、计量/测量技术、生物技术、显微操纵。

规格

	PD73Z2ROW / P-736.ZRN2S	PD73Z2COW / P-736.ZCN2S	单位	公差
	带P-736.ZRO平台用于奥林巴斯显微镜/P-736.ZRN2平台用于尼康显微镜的低成本系统	带P-736.ZCO平台用于奥林巴斯显微镜/P-736.ZCN2平台用于尼康显微镜的高精度系统		
主动轴	Z	Z		
运动和定位				
集成传感器	压阻式	电容式		
闭环行程	220	220	微米	
闭环分辨率	1	1	纳米	典型值
机械特性				
谐振频率，带负载，100 克时	250	250	赫兹	
推荐负载*	500	500	克	最大
驱动特性				
压电陶瓷	PICMAP-885	PICMAP-885		
其他				
工作温度范围	15 到 40	15 到 40	°C	
材料	铝	铝		
质量	850	850	克	±5 %
电缆长度	1.7	1.7	米	±10 毫米
压电式控制器	E-709数字伺服（随机配件）			
通信接口	USB、RS-232、SPI			
输入/输出连接器	HD-Sub-D26针 1个模拟量输入0至10伏 1个传感器监控器0至10伏 1个数字输入（LVTTTL、可编程） 1个模拟输出 5个数字输出（LVTTTL、3个为预定义、2个为可编程）			
指令集	PI General Command Set (GCS)			
用户软件	PIMikroMove			
软件驱动器	LabVIEW驱动器，用于Windows和Linux的动态库 支持MATLAB、MetaMorph、µManager、Andor iQ			
支持功能	波形发生器、数据记录器、自动调零、触发I/O			
控制器尺寸	160 毫米 × 96 毫米 × 33 毫米			

* 用于动态操作。负载减小，动态更高。

订购信息

带控制器的机械特性

PD73Z2ROW /

Pinano® Z向压电陶瓷扫描仪系统

带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置奥林巴斯显微镜，220微米，带USB数字控制器的压阻式传感器

PD73Z2COW /

Pinano® Z向压电陶瓷扫描仪系统

带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置奥林巴斯显微镜，220微米，带USB数字控制器的电容传感器

可用配件

M-687.AP1

用于显微镜载片和培养皿（用于带160毫米×110毫米通光孔径的PI平台）的通用支架

P-736.WPO

用于微量滴定板的支架，用于P-736.ZxOPinano®

Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置奥林巴斯显微镜）

P-736.PDO

培养皿支架，35毫米培养皿，用于P-736.ZxOPinano®

Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置奥林巴斯显微镜）

P-736.SHO

显微镜载片支架，用于P-736.ZxOPinano®

Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置奥林巴斯显微镜）

带控制器的机械特性

P-736.ZRN2S

Pinano® Z向压电陶瓷扫描仪系统

带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置尼康显微镜，220微米，带USB数字控制器的压阻式传感器

P-736.ZCN2S

Pinano® Z向压电陶瓷扫描仪系统

带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置尼康显微镜，220微米，带USB数字控制器的电容传感器

可用配件

P-736.UHN

用于显微镜载片和培养皿的通用支架，用于P-736.ZxN2Pinano®

Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

P-736.WPN

微量滴定板的支架，用于P-736.ZxN2Pinano®

Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

P-736.PDN

培养皿支架，35毫米培养皿，用于P-736.ZxN2Pinano®

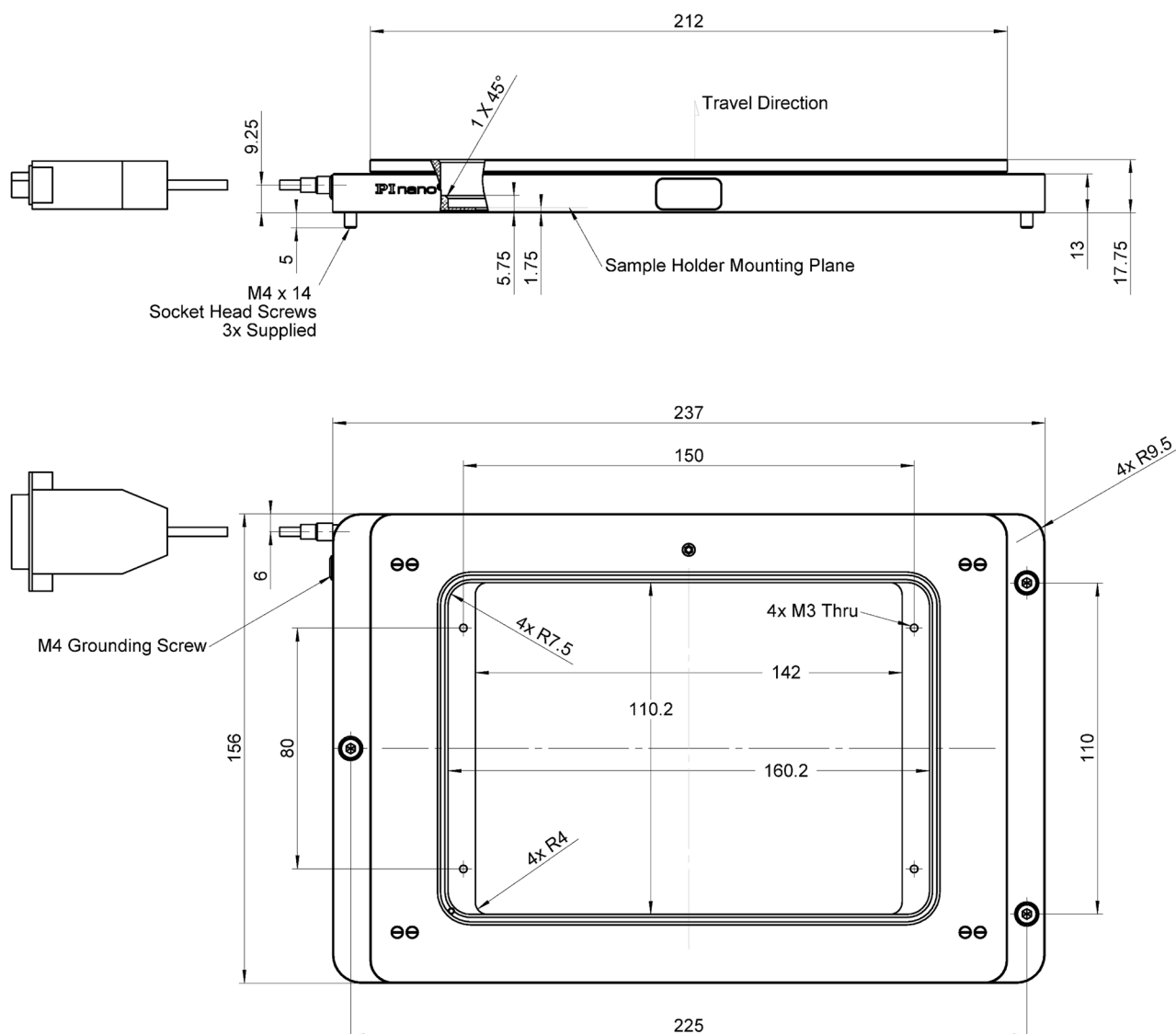
Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

P-736.SHN

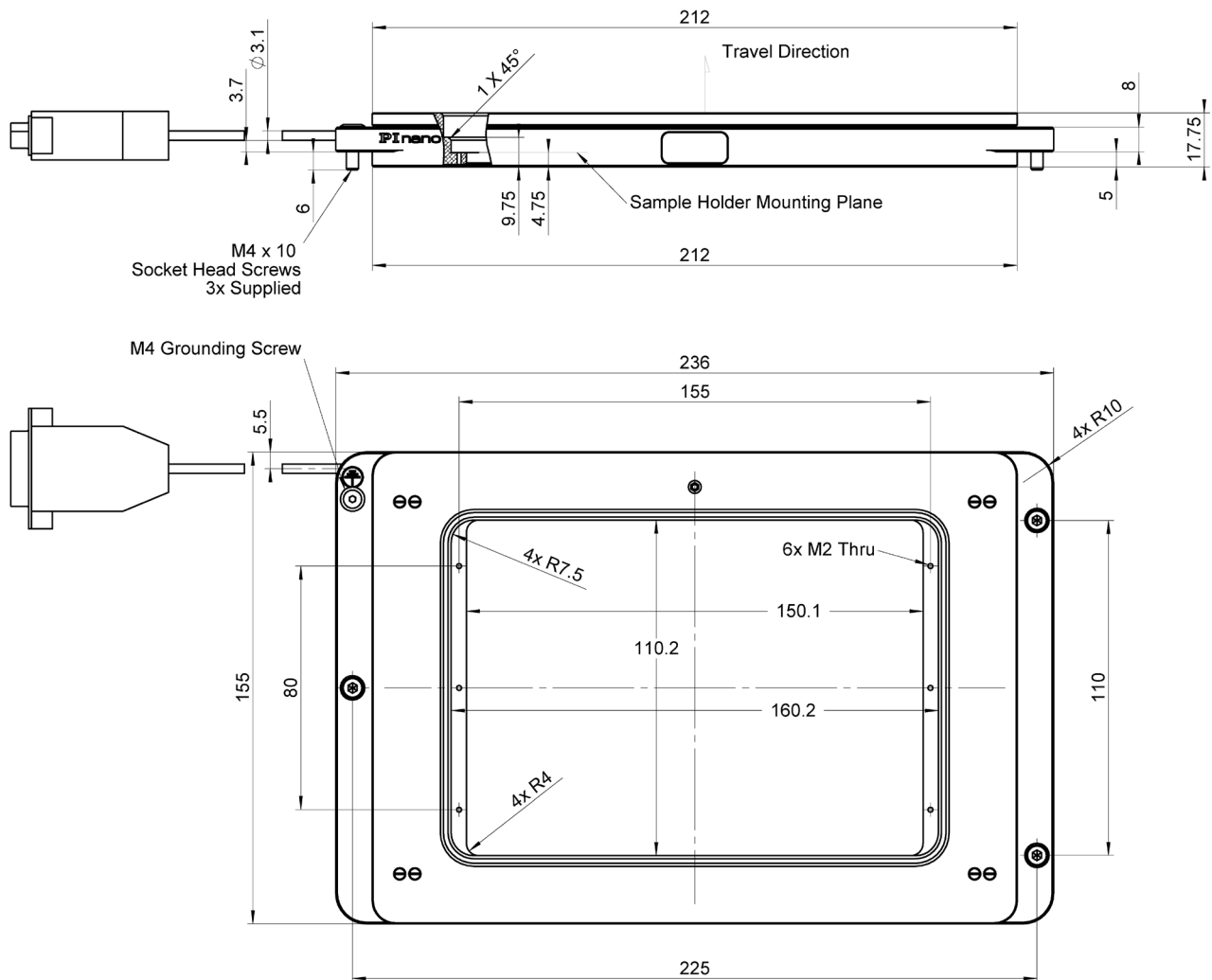
显微镜载片支架，用于P-736.ZxN2Pinano®

Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

图纸/图片



P-736.ZCO / P-736.ZRO, 尺寸单位为毫米



P-736.ZCN2 / P-736.ZRN2, 尺寸单位为毫米



P-736.ZCN2结合M-687 XY位移平台, 带超大通光孔径